МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)

Основы физической и квантовой оптики

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОПУСКАНИЯ В LINbO₃ С ЛЕГИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ФОТОРЕФРАКТИВНЫМИ ПРИМЕСЯМИ

Руководство к лабораторной работе для студентов специальности 210401 - Физика и техника оптической связи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР)

	•
	УТВЕРЖДАЮ Зав. каф. СВЧиКР
	С.Н.Шарангович
•	'"2011 г.
Основы физической	и квантовой оптики
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКО ЛЕГИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОС ПРИМЕ	СТИ ФОТОРЕФРАКТИВНЫМИ
Руководство к лабораторной работе дл Физика и техника	
Разі	работчики:
профес	сор кафедры СВЧиКР
	В.М.Шандаров нт кафедры СВЧиКР
	нт кафедры СВЧикР В.Г. Круглов
	В.г. круглов г. кафедры СВЧиКР
	П.А. Карпушин

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	3
2.	Изменение оптического пропускания плоскопараллельных	образцов
	LiNbO ₃	3
3.	Физические процессы, вносящие вклад в изменение о	птического
	пропускания в образцах LiNbO ₃	6
	3.1 Некоторые свойства ниобата лития	6
	3.2. Фоторефрактивный эффект	7
	3.3. Термооптический эффект	8
4.	Схема эксперимента	8
5.	Контрольные вопросы	9
6.	Задание и рекомендации по выполнению работы	10
Pe	екомендуемая литература	11

1. ВВЕДЕНИЕ

В современном приборостроении находят широкое применение оптические элементы и устройства (оптические переключатели, оптические и волоконно-оптические датчики и т.п.). При их создании часто используются нелинейно-оптические материалы, физические свойства которых могут изменяться при воздействии света. Подобные материалы, например кристаллы ниобата лития (LiNbO $_3$), представляют существенный интерес в плане реализации на их основе различных электрооптических, фоторефрактивных, голографических и нелинейно-оптических элементов. Некоторые физические характеристики LiNbO $_3$ существенно зависят от присутствия в кристалле легирующих примесей, например железа (Fe) и меди (Cu). Существуют различные методы легирования. Особый интерес представляет поверхностное легирование, позволяющее получить высокую концентрацию примесей и локальное легирование разных участков поверхности комбинациями разных примесей.

Целью данной лабораторной работы является экспериментальное исследование эффекта изменения оптического пропускания кристаллических образцов $LiNbO_3$ с поверхностью, легированной ионами железа и меди, под влиянием коротковолнового некогерентного излучения.

2. ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОПУСКАНИЯ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ Linbo₃

В работе исследуется оптическое пропускание плоскопараллельных образцов $LiNbO_3$, в том числе его изменение под влиянием излучения некогерентной подсветки, при длине волны когерентного зондирующего света λ =633 нм. Вклад разных механизмов в это изменение иллюстрируется схемой на рис. 2.1.

Пусть свет от источника излучения падает на поверхность исследуемого образца и частично отражается от этой поверхности. Световая волна, прошедшая в образец, претерпевает многократное отражение от его граней и может ослабляться, если поглощение света в материале отлично от нуля. Таким образом, прошедшее через образец излучение представляет собой результат интерференции многих световых волн. Наличие поглощения может привести к изменению температуры материала и, как следствие, к изменению величины показателя преломления вследствие его температурной зависимости. В свою очередь, это также влияет на результат интерференции, определяющей интенсивность прошедшего через образец светового поля. Таким образом, рассматриваемый случай соответствует нелинейному интерферометру Фабри-Перо. Для рассматриваемого материала коэффициент отражения света на

границе раздела с воздухом невелик (~14% по интенсивности), поэтому вместо многолучевой интерференции можно рассматривать интерференцию лишь двух пучков, учитывая лишь одно переотражение света в образце. При таком подходе выражение для интенсивности прошедшего света при отсутствии поглощения можно получить следующим образом.

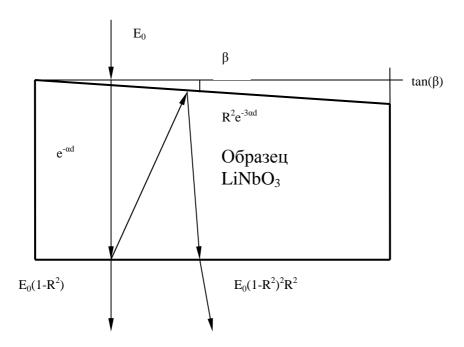


Рисунок 2.1 – Схема прохождения пучка света через исследуемый образец

На входе образца волна имеет вид:

$$E = E_0 \cdot \exp(j \cdot \omega \cdot t), \tag{2.1}$$

где E_0 – напряженность электрического поля; ω – круговая частота, t - время. Прошедшее в образец поле имеет вид:

$$E_1 = E_0 \cdot (1 - R^2)^{1/2} \cdot \exp(j \cdot \omega \cdot t), \qquad (2.2)$$

Здесь R - френелевский коэффициент отражения. Пройдя через образец, у его нижней грани, вид поля волны принимает форму:

$$E_2 = E_0 \cdot (1 - R^2)^{1/2} \cdot \exp(j \cdot (\omega \cdot t - k \cdot d)). \tag{2.3}$$

Проходя наружу через нижнюю грань образца, световое поле приобретает вид:

$$E_3 = E_0 \cdot (1 - R^2) \cdot \exp(j \cdot (\omega \cdot t - k \cdot d)). \tag{2.4}$$

Частично отражённая от нижней грани волна распространяется в образце до верхней грани. Здесь она также частично отражается и частично выходит из образца. Отражённая волна имеет вид:

$$E_4 = E_0 \cdot (1 - R^2)^{1/2} \cdot R^2 \cdot \exp(j \cdot (\boldsymbol{\omega} \cdot t - 2 \cdot k \cdot d)). \tag{2.5}$$

Отражённая от верхней грани волна вновь проходит через образец.

Итак, запишем выражение для вторично прошедшего через образец поля, вышедшего через нижнюю грань образца:

$$E_5 = E_0 \cdot (1 - R^2) \cdot R^2 \cdot \exp(j \cdot (\omega \cdot t - 3 \cdot k \cdot d)). \tag{2.6}$$

Составляющие E_3 и E_5 когерентны и разность их фаз не зависит от времени. Поскольку интенсивность отраженной волны при переходе света через границу «воздух — ниобат лития» составляет чуть более 10%, в анализе принимаем во внимание только две этих составляющих, пренебрегая вкладом других переотражений. Суммарная интенсивность светового поля, прошедшего через образец, таким образом, определяется соотношением:

$$I_{\Sigma} = (E_3 + E_5) \cdot (E_3 + E_5)^*,$$

откуда получим:

$$I_{\Sigma} = E_3 E_3^* + E_3 E_5^* + E_5 E_3^* + E_5 E_5^*. \tag{2.7}$$

Подставляя (2.4) и (2.6) в выражение (2.7) получим интенсивность суммарного поля:

$$I_{\Sigma} = E_0^2 \cdot (1 - R^2)^2 \cdot [1 + 2 \cdot R^2 \cdot \cos(k \cdot d) + R^4]. \tag{2.8}$$

где $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}$ — волновое число света в вакууме; λ — длина волны; d — толщина исследуемого образца.

Итак, мы получили выражение для интенсивности света при условии, что поглощение отсутствует. Оно показывает, что интенсивность света, прошедшего через образец, меняется по гармоническому закону в зависимости от толщины кристалла.

Пучок света, проходя через исследуемый образец, ослабляется вследствие конечного оптического поглощения материала и отражения от поверхностей образца. Рассмотрим выражения для интенсивности прошедшего света с учётом оптического поглощения в соотношении (2.8).

Учтём это, помножив правую часть в выражении (2.4) на $\exp(-\alpha \cdot d)$, а в выражении (2.6) на $\exp(-3 \cdot \alpha \cdot d)$, тогда получим:

$$I_{\Sigma} = E_0^2 \cdot (1 - R^2)^2 \cdot \exp(-2 \cdot \alpha \cdot d) \cdot [1 + 2 \cdot R^2 \cdot \cos(k \cdot d) \cdot \exp(-2 \cdot \alpha \cdot d) + R^4 \cdot \exp(-4 \cdot \alpha \cdot d)]. \tag{2.9}$$

Необходимо также учесть влияние температуры на оптическое пропускание образца. Для этого в выражении (2.9) введем температурную

зависимость показателя преломления n(T) и изменение толщины образца вследствие теплового расширения:

$$I_{\Sigma} = E_0^2 \cdot (1 - R^2)^2 \cdot \exp(-2 \cdot \alpha \cdot d(T)) \cdot \left[1 + 2 \cdot R^2 \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot d(T)n(T)}{\lambda}\right) \times \exp(-2 \cdot \alpha \cdot d(T)) + R^4 \cdot \exp(-4 \cdot \alpha \cdot d(T)) \right]$$

$$n(T) = n_0 + \frac{\partial n}{\partial T} \Delta T$$
(2.10)

где ${\bf n}_0$ – показатель преломления; $\overline{\partial T}$ – его температурный коэффициент; $\Delta {\bf T}$ – изменение температуры,

$$d(T) = d_0 + \frac{\partial d}{\partial T} \cdot \Delta T,$$

где d_0 — начальная толщина образца; $\frac{\partial u}{\partial T}$ — коэффициент теплового расширения материала.

Наконец, величина оптического пропускания образца (отношение интенсивности прошедшего светового поля к интенсивности падающего на образец) определяется соотношением:

$$I_{\Sigma C} = (1 - R^2)^2 \cdot \exp(-2 \cdot \alpha \cdot d(T)) \cdot \left[1 + 2 \cdot R^2 \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot d(T)n(T)}{\lambda}\right) \times \exp(-2 \cdot \alpha \cdot d(T)) + R^4 \cdot \exp(-4 \cdot \alpha \cdot d(T)) \right]$$
(2.11).

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ВНОСЯЩИЕ ВКЛАД В ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОПУСКАНИЯ В ОБРАЗЦАХ Linbo₃

3.1 Некоторые свойства ниобата лития

Впервые кристаллы $LiNbO_3$ были получены еще в 1937 году. Монокристаллы $LiNbO_3$ нашли применение в электрооптических модуляторах, нелинейно-оптических, акустооптических и интегрально-оптических элементах. Данный кристалл обладает уникальным набором физических свойств: электрооптических, пьезоэлектрических и нелинейно-оптических коэффициентов в комбинации с химической стабильностью и прозрачностью в широком диапазоне длин волн света. Основные характеристики $LiNbO_3$ представленны в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Основные характеристики LiNbO₃.

Химическая формула	LiNbO ₃
Симметрия кристалла	Тригональная, 3m
Плотность, $\Gamma/\text{см}^3$	4,628
Температура плавления, °С	1255
Растворимость	Нерастворим в воде
Цвет	Бесцветен
Диапазон прозрачности, нм	350-5500
Показатель преломления при 633 нм	$n_{o} = 2,29$
	$n_{\rm e} = 2,20$
Электрооптические коэффициенты при 633 нм	$r_{33} = 30.8$
(высокочастотные), пм/В	$r_{13} = 8,6$
	$r_{22} = 3,4$
Температурный коэффициент показателя	0,7 10 ⁻⁵
преломления для обыкновенной волны, 1/0С	

Как отмечено выше, объектом исследования в данной работе являются образцы ниобата лития с поверхностью, легированной фоторефрактивными примесями Fe и Cu. Вклад в изменение величины их оптического пропускания могут вносить следующие эффекты:

- о наведение оптической неоднородности в силу фоторефрактивных свойств образца;
- о термооптический эффект, вследствие которого при изменении температуры изменяется показатель преломления материала;
- \circ эффект нелинейного изменения поглощения фоторефрактивного образца под действием когерентного излучения с длиной волны λ =633 нм.

3.2. Фоторефрактивный эффект.

Фоторефрактивный эффект (ФРЭ) или эффект фоторефракции заключается в изменении показателя преломления диэлектрических или полупроводниковых материалов под действием света. Впервые он был обнаружен в 1965 году в ниобате лития при проведении экспериментов в области нелинейной оптики.

Фоторефрактивный эффект наблюдается в кристаллических материалах без центра симметрии. Он является результатом нескольких элементарных процессов:

а) фотовозбуждения носителей электрического заряда, например, электронов, с энергетических уровней активных примесных центров в запрещенной зоне, в зону проводимости;

- б) перераспределения фотовозбужденных носителей в пространстве вследствие тепловой диффузии, под действием внешнего электрического поля или вследствие фотовольтаического эффекта;
- в) захвата носителей заряда в неосвещенных областях глубокими ловушечными центрами и, в результате, появления электрического поля пространственного заряда;
- г) модуляции показателя преломления среды полем пространственного электрического заряда вследствие линейного электрооптического эффекта.

Величина изменения преломления показателя материала при $\Delta n^{\phi p}$ фоторефрактивном эффекте определяется величиной поля пространственного и соответствующих заряда E_{sc} электрооптических коэффициентов *r*:

$$\Delta n^{\phi p} = -\frac{n^3 r E_{sc}}{2} \tag{2.1}$$

Фоторефрактивный эффект в некоторых электрооптических кристаллах приводит к очень сильной оптической нелинейности, однако эта нелинейность является медленной. Время установления и релаксации поля E_{sc} может составлять от минут до месяцев для кристаллов ниобата лития.

3.3. Термооптический эффект

Фоторефрактивный и термооптический эффекты приводят к изменению оптической длины пути света, прошедшего через плоско – параллельный образец. Изменение оптического пропускания образца зависит также от его толщины и от непараллельности граней (клиновидности). Таким образом, целью данной работы является исследование зависимости изменения оптического пропускания образцов LiNbO₃, легированных Fe и Cu, с учётом перечисленных факторов.

3. СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА

Целью экспериментальных исследований является исследование изменения оптического пропускания образцов ниобата лития с поверхностным легированием железом и медью, при изменении температуры и наличия некогерентной коротковолновой подсветки. Схема экспериментальной установки изображена на рис. 3.1.

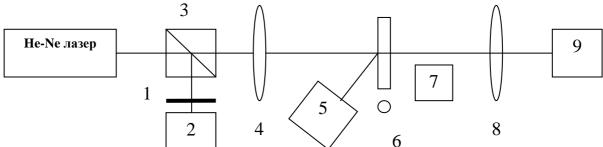


Рисунок 3.1 — Схема экспериментальной установки: 1 - фильтр, предназначенный для ослабления интенсивности света, 2 - фотоприёмный элемент для контроля мощности излучения лазера, 3 - светоделительный кубик, 4 - линза, 5 - светодиод с длиной волны $\lambda = 470 \,$ нм; 6 - образец LiNbO $_3 +$ на микрометрическом столике, 7 - термометр для контроля температуры окружающей среды, 8 - линза, собирающая свет после образца на поверхность фотоприёмника, 9 - фотоприёмный элемент.

В установке луч Не-Ne лазера ($\lambda = 633$ нм) с оптической мощностью ~ 0.5 мВт и апертурой ~ 1 мм проходит через образец в направлении нормали к его поверхности. Мощность прошедшего светового пучка измеряется с помощью линзы (8) и фотодиода (9). Источником некогерентного излучения является светодиод (5). Температура вблизи образца измеряется с помощью термометра (7). Выходная мощность лазера контролируется с помощью светоделительного кубика (3) и фотодиода (2).

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 4.1. Пояснить суть эффекта фоторефракции.
- 4.2. Что такое термооптический эффект?
- 4.3. Пояснить в чём преимущество поверхностного легирования фоторефрактивных образцов в сравнении с объёмным легированием.
- 4.4. Как влияет изменение температуры образца на пространственную зависимость оптического пропускания?
- 4.5. Какие физические процессы вносят вклад в изменение величины оптического пропускания в легированной поверхности образца?
- 4.6. Как соотносится амплитуда поля волны до образца и прошедшей волны через образец? Как соотносятся их интенсивности?
- 4.7. Используя рис. 2.1. объяснить, чем обусловлен гармонический характер изменения оптического пропускания при разных положениях зондирующего пучка вдоль оптической оси образца.

5. ЗАДАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

- а) Ознакомиться с теорией и элементами экспериментальной установки.
- б) Получить от преподавателя допуск к выполнению работы, включить лазер и измерительные приборы и дать им прогреться в течение не менее 30 мин.
- в) Измерить и построить экспериментальную зависимость оптического пропускания образца $LiNbO_3$ от координаты вдоль оптической оси с шагом 100 мкм.
- г) Через время 10÷30 минут повторить эксперимент. Построить в MS Excel полученные зависимости и объяснить.
- д) Установить источник некогерентного излучения таким образом, чтобы лазерный пучок проходил через образец в центре освещенной области. При необходимо, положение зондирующего лазерного ЭТОМ чтобы соответствовало скату зависимости, полученной при выполнении пунктов в) и г). Выключить коротковолновую подсветку и проследить за изменением мощности прошедшего через образец зондирующего пучка в течение 1-5 минут. Включить некогерентную подсветку и провести измерение мощности прошедшего зондирующего пучка в течение 1-5 минут. После выключения подсветки продолжать измерения мощности зондирующего пучка в течение 1 -5 минут. Построить полученную зависимость в MS Excel.
- е) Повторить эксперимент д), выбрав положение зондирующего пучка на противоположном скате кривой, полученной при выполнении пунктов в) и г).
- ж) Оформить отчет о проведенных в рамках лабораторной работы исследованиях и сдать его преподавателю.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. М.Б. Виноградова, О.В. Руденко, А.П. Сухоруков. Теория волн. М.: Наука. Гл. ред. физ. мат. лит., 1979. 384 с.
- 2. М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике. СПб.: Наука. С. Петерб. отд., 1992. 320 с.
- 3. А.Ярив, П.Юх. Оптические волны в кристаллах. М .: Мир, 1987. 616с.